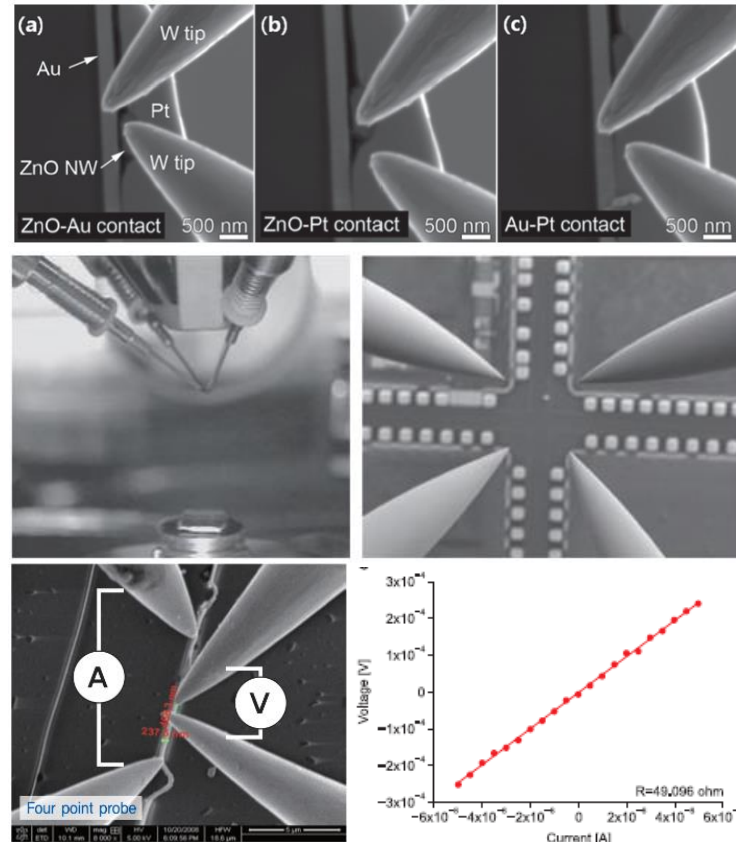


# 제 1회 현미경을 이용한 전기계측 워크숍

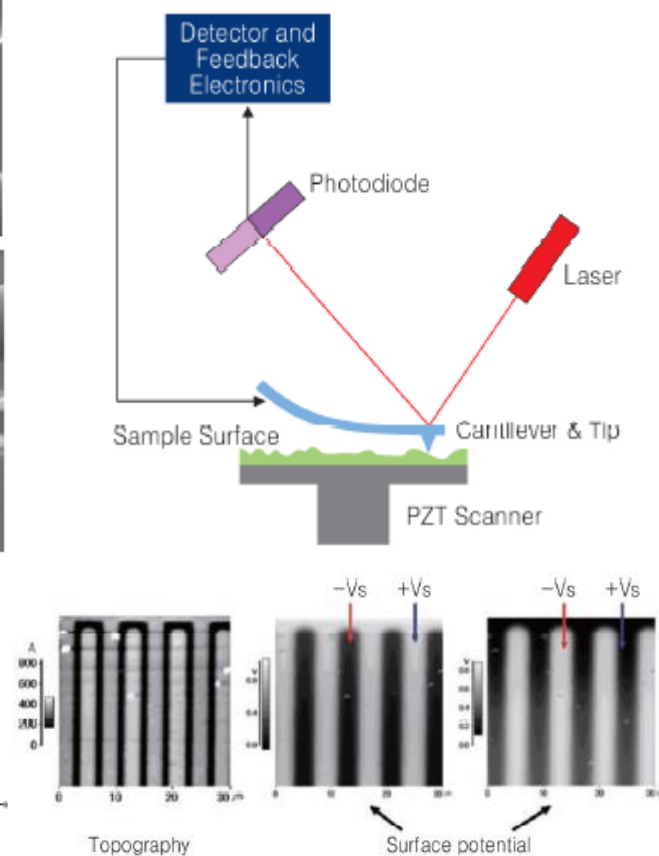
Advanced Analysis Center (AAC)



## ❖ Focused Ion Beam (FIB)



## ❖ Atomic Force Microscopy (AFM)



- **일시** : 2017. 12. 14 (목)
- **장소** : 한국과학기술연구원 (KIST), L5223호
- **주관** : 한국과학기술연구원 (KIST)
- **후원** : 키사이트 (Keysight Technologies Korea, 구. 애질런트)
- **문의** : 김양희 (02-958-6973, yhkim1022@kist.re.kr)

## ❖ 초대말씀

안녕하십니까? 한국과학기술연구원(KIST) 특성분석센터입니다. 우리 센터에서 현미경을 이용한 전기적 특성분석기법에 대해 소개하는 자리를 마련 하였습니다. 현미경에 Nano-Probing 기술을 접목시켜 표면 및 미세 구조 분석뿐만 아니라 전기적 특성 분석을 통한 저전류 계측 기반 연구 분야를 소개함으로써 여러분들의 연구에 도움을 드리고자 합니다. 또한, 저전류 계측 시 높은 정밀도 및 분석의 신뢰성을 얻기 위해 필요한 분석 변수들을 파악함으로써 연구의 질을 향상시키고자 합니다. 많은 분들의 관심과 참여 부탁드립니다. 감사합니다.

## ❖ 워크숍 프로그램

시간	내용	연사(소속)	
09:00	09:30	워크숍 등록	
09:30	09:40	개회사	안재평(KIST)
09:40	10:40	전기 계측의 기초 이론	김정태 (키사이트)
10:40	10:50	질의 응답	
10:50	11:50	저전류 계측기 Application 소개 및 기초 계측기 실습	
11:50	13:00	외빈관 점심 식사	
13:00	13:40	나노소자에서의 전기적 특성 측정	구현철(KIST)
13:40	14:20	1D/2D 나노재료를 이용한 전자소자 특성측정에서의 원리와 이슈	김규태 (고려대)
14:20	15:30	Coffee break	
15:30	16:10	전자현미경과 이를 이용한 전기적 특성 분석	안재평(KIST)
16:10	16:50	AFM 기초 및 전기 계측 응용	김윤석 (성균관대)
16:50	17:00	장비 실습실 이동	각 장비 실습조교
17:00	18:00	FIB전기계측 실습 ( L5115C호 )	
		AFM 전기계측 실습 ( L2332호 )	

## ❖ 등록 안내

- **일시** : 2017년 12월 14일(목)
- **장소** : 한국과학기술연구원(KIST), L5223호
- **대상** : 산업체 및 연구소 연구원, 대학원생
- **인원** : 총 30명 (선착순)
  - 실습 : 총 10명 (FIB & AFM 각 장비별 5명씩)
  - 장비실 공간이 협소한 관계로 실습은 소수정예로 진행
- **등록** : 담당자에게 참가신청서 작성 후, 메일 접수
- **문의** : 김양희 (02-958-6973, yhkim1022@kist.re.kr)
- **접수 내용** : 아래 표 참고, 별첨

성명			
소속기관		직급	
연락처	유선전화/휴대폰		
	e-mail		
참석희망과정 (택1)	<input type="checkbox"/> 강의만		
	<input type="checkbox"/> 강의+FIB 실습		
	<input type="checkbox"/> 강의+AFM 실습		

※ 1회 개최 기념, 관련 연구 분야의 활성화를 위해 등록비 없이 무료로 진행 됩니다.

## ❖ 찾아오시는 길

- 주소 : 서울시 성북구 화랑로 14길 5 KIST, L5동
- **지하철 6호선 상월곡역** → 4번출구 (도보 5분) → KIST 북문(도보 10분) → L5동 2층, L5223호



서울특별시 성북구 화랑로 14길 5 우) 136-791 Tel. 02-958-5114